

Publications

- Becker, H.; Röpke, W.; Rötting, O.; Gärtner, C.:
Polymer Microfabrication Technologies
In: Proceedings Micro System Technologies, Düsseldorf 2001, (2001) p. 401–406, ISBN 3-8007-2601-7
- Bräuer, A.; Dannberg, P.; Mann, G.; Popall, M.:
Precise Polymer Micro-Optical Systems
In: MRS BULLETIN, 26 (2001) 7, p. 519–522, ISSN 0883-7694
- Buestrich, R.; Kahlenberg, F.; Popall, M.; Dannberg, P.; Müller-Fiedler, R.; Rösch, O.:
ORMOCER®s for optical interconnection technology
In: Journal of Sol-Gel Science and Technology, 20 (2001) p. 181–186, ISSN 0928-0707
- Buß, W.; Mohaupt, M.; Woldt, G.:
Developing a small-series-capable technology for the wafer level integration of optoelectronic and micro-optical components
In: VTE-Packaging and Interconnection Technology in Electronics, 13 (2001) 5, p. E78–E85, ISSN 0946-7777
- Buß, W.; Mohaupt, M.; Woldt, G.:
Kleinserientaugliche Montage-technologie zur Wafer-Level-Integration optoelektronischer und mikro-optischer Bauelemente
In: VTE-Aufbau und Verbindungstechnik in der Elektronik, 13 (2001) 5, p. 241–248, ISSN 0946-7777
- Buß, W.; Sieß, G.:
Design und Realisierung eines schnellen Form-/Farbsensor-Moduls für prozessnahe industrielle Anwendungen
In: Arbeitsberichte des Instituts für Informatik der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, 34 (2001) 15, p. 99–113, ISSN 0344-3515
- Damm, Ch.; Peschel, Th.; Gebhardt, A.; Kirschstein, U. C.:
Adjustment and mounting of stencil mask for ion projection lithography
In: Microelectronic Engineering, 57–58 (2001) p. 181–185, ISSN 0167-9317
- Damm, Ch.; Peschel, Th.; Risse, St.; Kirschstein, U. C.:
Wafer stage assembly for ion projection lithography
In: Microelectronic Engineering, 57–58 (2001) p. 181–185, ISSN 0167-9317
- Duparré, A.; Kozhevnikov, I., Glied, S.; Steinert, J.; Notni, G.:
Surface characterization of optical components for the DUV, VUV and EUV
In: Microelektronik Engineering, 57–58 (2001) p. 65–70, ISSN 0167-9317
- Duparré, A.; Notni, G.:
Messverfahren zur Untersuchung optischer Oberflächen für den VUV- bis IR-Bereich
In: 1. Tagung „Optik und Optronik in der Wehrtechnik“, 25.–27.09.01, Meppen, (2001) p. 7–19 – 7–24, ISBN 3-965938-00-4
- Feigl, T.; Lauth, H.; Yulin, S.; Kaiser, N.:
Heat resistance of EUV multilayer mirrors for long-time applications
In: Microelectronic Engineering, 57–58 (2001) p. 3–8, ISSN 0167-9317
- Ferré-Borrull, J.; Duparré, A.; Quesnel, E.:
Procedure to characterize microroughness of optical thin films: application to ion-beam-sputtered vacuum-ultraviolet coatings
In: Applied Optics, 40 (2001) 13, p. 2190–2198, ISSN 0003-6935
- Gatto, A.; Kaiser, N.; Thielsch, R.; Garzella, D.; Hirsch, M.; Nutarelli, D.; Ninno, De G.; Renault, E.; Couprie, M.E.; Torchio, P.; Alvisi, M.; Albrand, G.; Amra, C.; Marsi, M.; Trovo', M.; Walker, R.; Grewe, M.; Roger, J.P.; Boccara, C.:
Achromatic damage investigation on mirrors for UV Free Electron Lasers
In: Laser – induced damage in optical materials: 2000, Proceedings SPIE vol. 4347, (2001) p. 535–546, ISBN 0277-786X
- Gatto, A.; Thielsch, R.; Heber, J.; Kaiser, N.; Ristau, D.; Günster, S.; Kohlhaas, J.; Marsi, M.; Trovo', M.; Walker, R.; Garzella, D.; Couprie, M.E.; Torchio, P.; Alvisi, M.; Amra, C.:
High-performance DUV optics for Free Electron Lasers
In: Optical Interference Coatings, OSA Technical Digest (Optical Society of America, Washington, DC, 2001), ThB3_1-ThB3_3, ISBN 1-55752-682-6
- Guyenot, V.; Tittelbach, G.; Siebenhaar, C.:
Investigations of Alignment and Positioning Principles for Optical Detectors
In: Proceedings of the euspem 2nd International Conference, Turin, Italy – May 27th – 31st, (2001) p. 606–609
- Kaiser, N.:
New Applications for Optical Coatings
In: The Coatings Agenda Europe, (2001) p. 180–181
- Kaiser, N.:
Design optischer Schichtsysteme
In: Vakuum in Forschung und Praxis, (2001) 6, p. 1–7, ISSN 0947-076X
- Kaiser, N.:
Optical Coatings for Ultraviolet Radiation
In: The Coatings Agenda Europe, (2001) p. 178–179

- Kaiser, N.:
Review of fundamentals of thin film growth
In: Optical Interference Coatings, OSA Technical Digest (Optical Society of America, Washington, DC, 2001), MA1-1 – Ma1-3, ISBN 1-55752-682-6
- Kalkowski, G.; Risse, S.; Harnisch, G.; Guyenot, V.:
Electrostatic chucks for lithography applications
In: Microelectronic Engineering, 57-58 (2001) p. 219-222, ISSN 0167-9317
- Kley, E.-B.; Tünnermann, A.; Zeitner, U.D.; Karthe, W.:
Mikrooptische Elemente, Funktionen und lithographische Herstellungstechnologien
In: LaserOpto, 33 (2001) 3, p. 78-84, ISSN 1437-3041
- Kowarschik, R.; Notni, G.; Gerber, J.; Kühmstedt, P.; Schreiber, W.:
Trends in 3-D measurement with structured light
In: Holo Met 2001, Balatonfüred, Hungary 24 to 27 June 2001, (2001) p. 67-74
- Kuhlmann, T.; Yulin, S.; Feigl, T.; Kaiser, N.:
Cr/Sc Multilayer mirrors for the Nitrogen Ka-line in the water window
In: Optical Interference Coatings, OSA Technical Digest (Optical Society of America, Washington, DC, 2001), ThA3-1 – ThA3-3, ISBN 1-55752-682-6
- Kühmstedt, P.; Notni, G.; Hintersehr, J.; Gerber, J.:
CAD-CAM-System for Dental Purpose – an Industrial Application
In: Fringe 2001 – Workshop on Automatic Proceeding of Fringe Patterns 17.-19.09.01 in Bremen, (2001) p. 667-672, ISBN 2-84299-318-7
- Marsi, M.; Roux, R.; Trovò, M.; Walker, R.P.; Couprie, M.E.; Garzella, D.; Clarke, J.A.; Poole, M.W.; Wille, K.; Dattoli, G.; Giannessi, L.; Eriksson, M.; Werin, S.; Gatto, A.; Kaiser, N.; Günster, A.; Ristau, D.:
Completion of the First Phase of development of the European UV/VUV Free-Electron Laser at ELETTRA,
In: Synchrotron Radiation News, 14 (2001) 4, p. 19-24, ISSN 0894-0886
- Notni, G.:
3-D-Messtechnik auf der Basis Streifenprojektion im produktiven Umfeld
In: VDI Wissensforum Oberflächenprofilmesstechnik 27.-28.09.01 Stuttgart, (2001)
- Notni, G.H.; Notni, G.; Kühmstedt, P.:
Simultane 3-D Ganzkörperform- und Farberfassung
In: GFal-Tagung, 07.12.2001, Berlin, (2001) p. 29-36, ISBN 3-9807029-6-0
- Notni, G.:
360-deg shape measurement with fringe projection- calibration and application –
In: FRINGE 01, 4th International Workshop on Automatic Processing of fringe Patterns 17.-19.09.01 in Bremen, (2001) p. 311-323, ISBN 2-84299-318-7
- Notni, G.; Kaiser, T.; Godejohann, M.:
Weißlichtinterferometer zum Prüfen mikrostrukturierter Oberflächen
In: F&M Feinwerktechnik Mikroelektronik, 109 (2001) 1-2, p. 48-50, ISSN 1437-9503
- Notni, G.; Kühmstedt, P.; Gerber, J.:
Robuste optische 3-D Ganzkörpererfassung
In: 1. Tagung "Optik und Optronik in der Wehrtechnik", 25.-27.09.01, Meppen, (2001) 7-1 – 7-18, ISBN 3-965938-00-4
- Pertsch, T.; Zentgraf, T.; Streppel, U.; Bräuer, A.; Peschel, U.; Lederer, F.:
Control of Diffraction in Waveguide Arrays
In: Proc. ECIO 01, Paderborn, Germany April 2001, p. 21-24, ISBN 3-00-007634-4
- Pertsch, T.; Zentgraf, T.; Streppel, U.; Bräuer, A.; Peschel, U.; Lederer, F.:
Anomalous light transport and diffraction control in waveguide arrays
In: OSA Trends in Optics and Photonics (TOPS), 57, QELS Mai/2001 (2001) p. 168-169, ISBN 1-55752-677-X, LCCN: 00-111378
- Peschel, U.; Leine, L.; Lederer, F.; Wächter, C.:
Efficient micro bends for integrated optics and near field microscopy
In: Proc. ECIO 01, Paderborn, Germany April 2001, p. 281-284, ISBN 3-00-007634-4
- Peschel, U.; Leine, L.; Lederer, F.; Wächter, C.:
Bending the path of light with a microprism
In: OSA Trends in Optics and Photonics (TOPS) 56, CLEO Mai/2001, p. 129-130, ISBN 1-55752-676-1, LCCN 00-111375
- Protopapa, M. L.; Thomasi, De F.; Perrone, M.R.; Piegari, A.; Masetti, E.; Ristau, D.; Quesnel, E.; Duparré, A.:
Laser damage studies on MgF₂ thin films
In: Journal of Vacuum Science & Technology, 19 (2001) 2, p. 681-688, ISSN 0734-2101
- Rohrmoser, P.; Notni, G.; Kühmstedt, P.; Heinze, M.; Brakhage, P.:
Robust Volume Digitalization for Reverse Engineering Process Chains
In: μ -rapid 28.-30.05.2001, Amsterdam, p. 217-224, ISBN 3-00-007945-9

Schulz, U.; Kaiser, N.:
New coatings protect surfaces of plastic optics
In: EuroPhotonics, 6 (2001) p. 39–40, ISSN 1091-6083

Schulz, U.; Munzert, P.; Kaiser, N.:
Surface modification of PMMA by DC glow discharge and microwave plasma treatment for the improvement of coating adhesion
In: Surface and Coatings Technology, 142–144 (2001) p. 507–511, ISSN 0257-8972

Schulz, U.; Munzert, P.; Kaiser, N.:
Thermoplastics in plasma assisted coating processes
In: Optical Interference Coatings, OSA Technical Digest (Optical Society of America, Washington, DC, 2001), MF3–1 – MF3–3, ISBN 1-55752-682-6

Siebenhaar, C.:
Präzisionsjustierungen durch Einleitung von mechanischen Impulsen
In: Präzisionsjustierungen durch Einleitung von mechanischen Impulsen, (2001) ISBN 3-18-334001-1

Smesny, S.; Riemann, S.; Riehemann, S.; Bellemann, M.E.; Sauer, H.:
Quantitative Messung induzierter Hautrötungen mittels optischer Reflexionsspektroskopie – Methodik und klinische Anwendung
In: Biomedizinische Technik, 46 (2001) p. 280–286, ISSN 0013-5585

Smesny, S.; Riemann, S.; Riehemann, S.; Bellemann, M.E.; Sauer, H.:
Quantitative determination of Niacin-induced skin redness using optical reflection spectroscopy – methods and clinical application on schizophrenic patients
In: The world journal of biological psychiatry, 2 S1 (2001) p. 284S–285S, ISSN 1562-2975

Smesny, S.; Riemann, S.; Riehemann, S.; Bellemann, M.E.; Sauer, H.:
Interactions between cannabinoid consumption, phospholipid metabolism and schizophrenic symptoms – Preliminary results of an optical spectroscopic Niacin-Patch-Test investigation
In: The world journal of biological psychiatry, 2 S1 (2001) p. 282S, ISSN 1562-2975

Smesny, S.; Riemann, S.; Riehemann, S.; Bellemann, M.E.; Sauer, H.:
Evaluierung eines Meßverfahrens zur quantitativen Erfassung Niacin-induzierter Hautrötungen mittels optischer Reflexionsspektroskopie und klinische Anwendung bei schizophrenen Patienten
In: Abstracts der 3. Mitteldeutschen Psychiatrietage, Magdeburg, (2001) p. 66–67

Smesny, S.; Riemann, S.; Rosburg, T.; Riehemann, S.; Rudolph, N.; Baur, K.; Bellemann, M.E.; Sauer, H.:
Prostaglandinstoffwechsel bei schizophrenen Patienten – reflexions-spektroskopische Befunde mittels Niacin-Patch-Test
In: Kongress der Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie, Psychotherapie und Nervenheilkunde, Berlin, Der Nervenarzt, (2001) ISSN 0028-2804

Streppel, U.; Bräuer, A.; Dannberg, P.; Wächter, C.; Nicole, P.:
A Novel Fabrication Technology for Stacked Polymer Waveguide Devices
In: Proc. ECIO 01, Paderborn, Germany, April (2001) p.116–116, ISBN 3-00-007634-4

Streppel, U.; Dannberg, P.; Wächter, C.; Bräuer, A.:
Realisation of a vertical integration schema for polymer waveguides by a novel stacking technology
In: Proceedings SPIE vol. 4439, (2001) p. 72–79, ISBN 0-8194-4153-8

Streppel, U.; Dannberg, P.; Wächter, C.; Bräuer, A.; Nicole, P.; Fröhlich, L.; Houbertz, R.; Popall, M.:
Multilayer optical fan-out device composed of stacked monomode waveguides
In: Proceedings SPIE vol. 4453, (2001) p. 61–68, ISBN 0-8194-4167-8

Streppel, U.; Dannberg, P.; Wächter, C.; Bräuer, A.; Nicole, P.; Fröhlich, L.; Houbertz, R.; Popall, M.:
Development of a new fabrication method for stacked optical waveguides using inorganic-organic copolymers
In: Proceedings POLYTRONIC 2001, 1st International IEEE conference on Polymers and Adhesives in Microelectronics and Photonics, Potsdam, Germany, October 21–24, p. 329–335, ISBN 0-7803-7220-4

Tanev, S.; Feng, D.; Dods, S.; Tzolov, V.P.; Jakubczk, Z.J.; Chen, C.; Berini, P.; Wächter, C.; Pinheiro, H.F.; Barbero, A. P. L.; Hernández-Figueroa, H.E.:
Advances in the development of simulation tools for integrated optics devices: FDTD, BPM, and mode solving techniques
In: Proceedings SPIE vol. 4277, (2001) p. 01–20, ISBN 0-8194-3955-X

Thielsch, R.; Gatto, A.; Kaiser, N.:
Mechanical stress, and thermal-elastic properties of oxide coatings for use in the DUV spectral region
In: Optical Interference Coatings, OSA Technical Digest (Optical Society of America, Washington, DC, 2001), ThB6_1–ThB6_3, ISBN 1-55752-682-6

Thielsch, R.; Heber, J.; Kaiser, N.; Apel, O.; Mann, K.; Ristau, D.; Blaschke, H.; Arens, W.:

Absorption limited performance of $\text{SiO}_2/\text{Al}_2\text{O}_3$ multi-layer coatings at 193nm – a systematic study
In: Optical Interference Coatings, OSA Technical Digest (Optical Society of America, Washington, DC, 2001), ThA6–1, ThA6–3, ISBN 1-55752-682-6

Tikhonravov, A.V.; Trubetskov, M.K.; Krasilnikova, A.V.; Masetti, E.; Duparré, A.; Quesnel, E.; Ristau, D.:
Investigation of the surface micro-roughness of fluoride films by spectroscopic ellipsometry
In: Thin Solid Films, 397, July (2001) p. 229–237, ISSN 0040-6090

Torchio, P.; Gatto, A.; Alvisi, M.; Albrand, G.; Kaiser, N.; Amra, C.:
High-reflectivity dense UV mirrors
In: Optical Interference Coatings, OSA Technical Digest (Optical Society of America, Washington, DC, 2001), ThA7_1–ThA7_3, ISBN 1-55752-682-6

Uhlig, H.; Kaiser, N.:
Blocking improved narrow-band filters for the UV-B region
In: Optical Engineering, 40 (2001) 10, p. 2331–2337, ISSN 0091-3286

Yulin, S.; Kuhlmann, T.; Feigl, T.; Kaiser, N.:
Damage Resistant and Low Stress EUV Multilayer Mirrors
In: Emerging Lithographic Technologies V, 4343 (2001) p. 607–614, ISSN 0277-786X

Lectures and Poster Sessions

Beckert, E.:
Modul- und Schnittstellenkonzept für einen Greiferbaukasten
Lecture: Statusseminar "Greiferbaukasten für die Montage von Mikrosystemen", 2002–2003, 8 November 2001, Productronica 2001, Neue Messe München

Bräuer, A.; Dannberg, P.:
Molding tools and in-situ UV-moulding of precision microoptical elements
Lecture: International Mini-Symposium Sendai, August 2001, Japan

Bräuer, A.:
3-D wellenleiteroptisches Fan-out-Element
Lecture: ITG-Workshop Optische Aufbau- und Verbindungstechnik May 2001 Potsdam

Bräuer, A.; Dannberg, P.; Streppel, U. Wächter, C.; Zeitner, U.D.; Popall, M.:
Wafer-Scale Fabricated Microoptical and Guided Wave Interconnects in Stable Polymers
Lecture: International Conference on Photo-Responsive Organics and Polymers 2001, Cheju Korea, August 2001

Bräuer, A.; Karthe, W.; Eberhardt, R.; Dannberg, P.; Zeitner, U.:
Application Oriented Polymer Microoptics-Fabrication and Assembling (invited)
Lecture: Workshop on Optical MEMS and Integrated Optics MEMS Workshop, Bommerholz June 2001

Buß, W.; Sieß, G.:
Design und Realisierung eines schnellen Form-/Farbsensor-Moduls für prozessnahe industrielle Anwendungen
Lecture: 7. Workshop Farbbildverarbeitung Erlangen October 2001

Büttner, A.; Zeitner, U.D.:
Strahlhomogenisierung von LEDs mit Mikrolinsen
Poster: DGaO-Tagung 2001 Göttingen

Dannberg, P.:
Mikrooptische Elemente für den Einsatz in optischen Faserschaltern
Lecture: ITG-Workshop Optische Aufbau- und Verbindungstechnik May 2001 Potsdam

Dannberg, P.; Bräuer, A.; Bauer, T.:
Microoptical and Waveguide Microstructures by UV-replication
Technology for Optical Interconnects
Poster: Photonics West 2001, San Jose, USA

Dannberg, P.; Bräuer, A.; Göring, R.:
Replication for Precise Microoptical Structures
Poster: Micro & Nanoengineering (MNE) Jena 2001

Duparré, A.; Flemming, M.; Glied, S.; Steinert, J.:
Technique for total scatter measurement at 157 nm and 193 nm
Lecture: SPIE's 46th Annual Meeting, Opt. Science and Technology, San Diego

Duparré, A.; Flemming, M.; Steinert, J.; Reihls, K.:
Optical coatings with enhanced roughness for ultrahydrophobic, low scatter applications
Lecture: Topical Meeting and Tabletop Exhibit, Optical Interference Coatings, 15–20 July 2001 Banff/ Canada

Duparré, A.; Notni, G.:
Messverfahren zur Untersuchung optischer Oberflächen für den VUV- bis IR-Bereich
Lecture: 1. Tagung "Optik und Optronik in der Wehrtechnik", 25–27 September 2001, Meppen

- Duparré, A.; Steinert, J.:
Light scattering and roughness properties of DUV/VUV coatings
Lecture: Int. Workshop on Optical Coatings, Erice, 24–28 September 2001
- Duparré, A.; Steinert, J.:
Vermessung und Analyse von Nanostrukturen
Lecture: 2. Fachforum Nanotechnologie, 23–24 October 2001, Würzburg
- Eberhardt, R.; Mohaupt, M.; Palm, S.:
Klassifizierung von Mikrobauanteilen
Lecture: Abschlusspräsentation des Verbundprojektes Microfeed 2, Erfurt, 12–13 September 2001
- Feigl, T.; Heber, J.; Gatto, A.; Kaiser, N.:
Optics Developments in the VUV-Soft X-Ray Spectral Region
Lecture: 23rd International Free Electron Laser Conference 20-24 August 2001, Darmstadt, Germany
- Feigl, T.; Kuhlmann, T.; Yulin, S.; Kaiser, N.:
Design and fabrication of broadband and narrowband multilayers for EUV metrology
Poster: 3rd International Workshop on EUV Lithography 29–31 October 2001, Matsue-shi, Shimane, Japan
- Feigl, T.; Yulin, S.; Kuhlmann, T.; Kaiser, N.:
Design, deposition and characterization of EUV multilayer at Fraunhofer IOF Jena
Lecture: Lawrence Livermore National Laboratory (LLNL) 6 August 2001, Livermore, CA, USA
- Feigl, T.; Yulin, S.; Kuhlmann, T.; Kaiser, N.:
Damage resistant and low-stress Si-based multilayer mirrors
Poster: SPIE's 46th Annual Meeting, Conference Soft X-Ray and EUV Imaging Systems, 29 July–3 August, 2001, San-Diego, USA
- Feigl, T.; Yulin, S.; Kuhlmann, T.; Kaiser, N.:
Damage Resistant and Low Stress EUV Multilayer Mirrors
Lecture: 2001 International Microprocesses and Nanotechnology Conference 31 October–2 November 2001, Matsue-shi, Shimane, Japan
- Flemming, M.; Steinert, J.; Gliech, S.; Duparré, A.:
Messtechnik zur Bestimmung des totalen Streulichts bei 157 nm und 193 nm
Lecture: 102. DGaO – Jahrestagung/ June 2001 in Göttingen
- Gatto, A.:
Achromatic damage – Spectral-spatial dependence of the degraded optics
Lecture: TMR mid term review "Towards SRFEL at 200 nm" 20–22 February 2001, Rome, Italy
- Gatto, A.; Feigl, T.; Kaiser, N.; Garzella, D.; De Ninno, G.; Couprie, M.E.; Marsi, M.; Trovo', M.; Walker, R.; Grewe, M.; Wille, K.; Paoloni, S.; Reita, V.; Roger, J.P.; Boccara, C.; Torchio, P.; Albrand, G.; Amra, C.:
Multiscale degradations of storage ring FEL optics
Lecture: 23rd International Free Electron Laser Conference, 23–26 August 2001, Darmstadt, Germany
- Gatto, A.; Heber, J.; Kaiser, N., Ristau, D.; Günster, S.; Kohlhaas, J.; Marsi, M.; Trovo, M.; Walker, R.P.:
High performance UV/VUV optics for the SRFEL at ELETTRA
Lecture: 23rd International Free Electron Laser Conference, 23–26 August 2001, Darmstadt, Germany
- Gliech, S.; Duparré, A.:
Charakterisierung von lateralen Nanometerstrukturen mit optischen und nichtoptischen Messverfahren
Lecture: Posterabstrakt DGaO-Jahrestagung 2001
- Gliech, S.; Duparré, A.; Notni, G.:
Streulichtmessanordnung zur Untersuchung von Oberflächen und Schichten für die Optik, Halbleitertechnik, Kunststoff- und Metallverarbeitung
Lecture: Symposium: DGaO Jahrestagung
- Gorelik, T.; Kaiser, U.; Kuhlmann, T.; Yulin, S.; Glatzel, U.:
Transmission Electron Microscopy Study of the Cr/Sc Multilayer Structure
Lecture: A conference of modern Microscopical Methods, 9–14 September 2001, Innsbruck, Austria
- Guyenot, V.:
Montageausrüstungen für hybride Mikrosysteme
Lecture: VDI-Kolloquium in Ilmenau, 09 January 2001
- Guyenot, V.:
Montageequipments für hybride mikrooptische und mikromechanische Systeme
Lecture: VDI-Kolloquium in Schmalkalden, 10 January 2001
- Guyenot, V.:
Microassembly of Optics/Microoptics
Lecture: Ultra Precision Machining Seminar am 10 October 2001 Jena

Guyenot, V.; Eberhardt, R.:
Montage und Justierung mikro-
optischer Bauelemente
Lecture: 305. Jenaer Carl-Zeiss-Optik-
kolloquium, 25 September 2001 Jena

Kaiser, N.:
Review of fundamentals of thin film
growth
Lecture: 2001 Optical Interference
Coating Topical Meeting, 15–20 July
2001, Banff Centre for Conferences,
Banff, Alberta Canada

Kaiser, N.:
Aktuelle Anwendungen von
Nanoschichtsystemen in der Optik
Lecture: 2. Fachforum
Nanotechnologie, Die Schlüssel-
technologie des 21. Jahrhunderts in
der industriellen Anwendung,
23–24 October 2001 in Würzburg

Kaiser, N.:
Design optischer Schichtsysteme
Lecture: 4. Fachforum Schichten auf
Glas – Herstellung, Eigenschaften,
Mess- und Prüfmethode, Anwen-
dungen, 4–5 April 2001 in Regensburg

Kaiser, N.:
Optische Schichten für den ultravio-
letten Spektralbereich
Lecture: 4. Fachforum Schichten auf
Glas – Herstellung, Eigenschaften,
Mess- und Prüfmethode, Anwen-
dungen, 4–5 April 2001 in Regensburg

Kaiser, N.:
Eigenschaftsprofile optischer
Oberflächen
Lecture: Tagung
"Oberflächentechnik – Neue Anwen-
dungsfelder für optische Funktions-
schichten", 14 November 2001
in Mainz

Kaiser, N.:
Einstellung maßgeschneiderter Eigen-
schaftsprofile optischer Oberflächen
Lecture: 102. DGaO Jahrestagung,
6–9 June 2001 in Göttingen

Kalkowski, G.:
Elektrostatische Chucks für Litho-
graphie-Anwendungen
Poster: 308. Jenaer Carl-Zeiss-Optik-
kolloquium, 11 December 2001
in Jena

Kalkowski, G.; Risse, S.; Guyenot, V.:
Electrostatic Chuck Behaviour at
Ambient Conditions
Lecture: MNE 2001 (Micro- and Nano-
Engineering) Grenoble 16–19 Sep-
tember 2001

Karthe, W.; Bräuer, A.; Dannberg, P.;
Eberhardt, R.:
Polymer Microoptics – Fabrication,
Assembling, and Application
Lecture: Workshop on Optical MEMS
and Integrated Optics MEMS
Workshop, Bommerholz June 2001

Kowarschik, R.; Notni, G.; Gerber, J.;
Kühmstedt, P.; Schreiber, W.:
Trends in 3-D measurement with
structured light
Lecture: Holo Met 2001, Balatonfüred,
Hungary 24–27 June 2001

Kuhlmann, T.; Feigl, T.; Yulin, S.;
Kaiser, N.:
Design and fabrication of broadband
multilayer mirrors for EUV metrology,
Poster: 3rd International Workshop on
EUV Lithography, 29–31 October,
2001, Matsue-shi, Shimane, Japan

Kuhlmann, T.; Yulin, S.; Feigl, T.;
Kaiser, N.:
Cr/Sc Multilayer mirrors for the
Nitrogen Ka-line in the water window
Poster: Optical Interference Coatings
Topical Meeting, 15–20 July, 2001,
Banff, Canada

Kühmstedt, P.; Hintersehr, J.;
Riehemann, S.; Notni, G.; Gerber, J.:
Neue High-Speed Projektionstechnik
für die 3-D Koordinatenmessung
Lecture: DGaO-Jahrestagung 2001

Kühmstedt, P.; Notni, G.;
Hintersehr, J.; Gerber, J.:
CAD-CAM-System for Dental Purpose
– an Industrial Application
Lecture: FRINGE 01, 4th International
Workshop on Automatic Processing of
Fringe Patterns 17–19 September
2001 in Bremen

Laux, S.; Bernitzki, H.; Gäbler, D.;
Kaiser, N.:
Beschichtung ultrapräziser optischer
Oberflächen
Lecture: 102. DGaO Jahrestagung
2001 v. 6–9 June in Göttingen

Mohaupt, M.; Eberhardt, R.;
Steinkopf, R.:
Handhabung von Mikrokomponenten
Abschlusspräsentation des Verbund-
projektes Microfeed 2 Erfurt,
12–13 September 2001

Müller, Th.; Hoch, A.; Eberhardt, R.;
Gengenbach, U.:
Erste Ansätze für modular aufgebaute
Greifer
Lecture: Statusseminar "Greifer-
baukasten für die Montage von
Mikrosystemen", 2002–2003,
08 November 2001, Productronica
2001, Neue Messe München

Munzert, P.; Schulz, U.; Kaiser, N.:
Zeonex® und Topas® in Beschichtungs-
prozessen – Wechselwirkung mit Plas-
ma und Schichthaftung
Lecture: Tagungsband zum Workshop
"Innovative Kunststoffe für optische
Anwendungen", Jena May 2001

Munzert, P.; Schulz, U.; Kaiser, N.:
Beschichtung von Kunststoffen auf
Cycloolefinbasis für optische
Anwendungen
Lecture: Tagungsband zum zweiten
oberflächentechnischen Kolloquium
der Martin-Luther-Universität Halle-
Wittenberg, June 2001

- Notni, G.:
Mikrospiegel in der optischen Messtechnik
Lecture: Werkstattgespräch Mikrospiegel – Anforderungen an die Technik von morgen, Dresden, 10 October 2001
- Notni, G.:
360-deg shape measurement with fringe projection-calibration and application
Lecture: FRINGE 01, 4th International Workshop on Automatic Processing of fringe Patterns 17–19 September 2001 in Bremen
- Notni, G.:
3-D Messtechniken auf der Basis Streifenprojektion im produktiven Umfeld
Lecture: VDI Wissensforum Oberflächenprofilmesstechnik 27–28 September 2001 in Stuttgart
- Notni, G.; Kühmstedt, P.; Gerber, J.:
Robuste optische 3-D Ganzkörpererfassung
Lecture: 1. Tagung "Optik und Optronik in der Wehrtechnik", 25–27 September 2001, Meppen
- Notni, G.H.; Notni, G.; Kühmstedt, P.:
Simultane 3-D Ganzkörperform- und Farberfassung
Lecture: GFal-Tagung, 07 December 2001, Berlin
- Notni, G.; Notni, G.H.; Heinze, M.:
3-D Form- und Farbdigitalisierer – KOLIBRI-mobil
Lecture: Fraunhofer IPA Anwenderforum "Rapid Product Development", Stuttgart, 17 October 2001
- Pertsch, T.; Bräuer, A.; Peschel, U.; Lederer F.:
Switching in c^2 waveguide arrays
Lecture: NLGW, Clearwater, March 2001
- Pertsch, T.; Zentgraf, T.; Streppel, U.; Bräuer, A.; Peschel, U.; Lederer, F.:
Anomalous light transport and diffraction control in waveguide arrays
Lecture: QELS Mai 2001 Baltimore
- Peschel, U.; Leine, L.; Lederer, F.; Wächter, C.:
Bending the path of light with a microprism
Lecture: CLEO May 2001 Baltimore
- Pröger-Mühleck, R.; Gebhardt, A.; Guyenot, V.; Schinköthe, Ch.; Siebenhaar, Ch.:
Aerostatisch gelagerter Impulsantrieb zur Präzisionsjustage in der Mikro-technik
Lecture: GMM-Fachtagung Innovative Klein- und Mikroantriebe, Mainz 15 May 2001
- Reitemeier, B.; Notni, G.; Fichtner, D.:
Optische Abformung extraoraler Defekte
Lecture: 13. Int. Symposium für Chir. Prothetik und Epithetik, Linz, 5–7 October 2001
- Ristau, D.; Duparré, A.; et al. :
UV-Optical and Microstructural Properties of MgF₂- and LaF₃-Coatings deposited by lbs and PVD Processes
Lecture and Poster: Topical Meeting and Tabletop Exhibit "Optical Interference Coatings" 15–20 July 2001 Banff/Canada
- Rohrmoser, P.; Notni, G.; Kühmstedt, P.; Heinze, M.; Brakhage, P.:
Robust Volume Digitalization for Reverse Engineering Process Chains
Lecture: μ -rapid 28–30 May 2001, Amsterdam
- Schreiber, P.:
Design und Herstellung refraktiver Strahlformer
Lecture: IIG-Workshop Optische Aufbau- und Verbindungstechnik May 2001 Potsdam
- Schulz, U.:
Vakuumbeschichtung von Kunststoffen für optische Anwendungen
Lecture: Workshop "Innovative Kunststoffe für optische Anwendungen", Jena, May 2001
- Schulz, U.:
Optische Schichten auf Glas und Kunststoff
Lecture: Seminar "Kunststoff- und Glasoptik", Technische Akademie Esslingen, 5–6 November 2001
- Schulz, U.:
Optische Medien unter dem Gesichtspunkt anwendungsspezifischer Anforderungen
Lecture: Seminar "Kunststoff- und Glasoptik", Technische Akademie Esslingen, 5–6 November 2001
- Schulz, U.; Munzert, P.; Kaiser, N.:
Polycycloolefine – neue Polymere für die Optik
Lecture: Neues Dresdner Vakuumtechnisches Kolloquium (9. NDVaK), 18–19 October 2001, Dresden
- Schulz, U.; Munzert, P.; Kaiser, N.:
Thermoplastics in plasma-assisted coating processes
Poster: Optical Interference Coatings Topical Meeting, 15–20 July 2001, Banff, Canada
- Steinert, J.; Ferré-Borrull, J.; Duparré, A.:
Extending the Capabilities of Scanning Probe Microscopy for Microroughness Analysis in Surface Engineering
Lecture: Usermeeting Göttingen, 10–11 April 2001

Steinert, J.; Duparré, A.; Flemming, M.; Glied, S.:
Untersuchung der Lichtstreuung an Schichtkomponenten für 157 nm
Lecture: 102. DGaO-Jahrestagung/
June 2001 in Göttingen

Steinert, J.; Glied, S.; Duparré, A.:
Measurement of total backscattering and forward scattering at vacuum-UV wavelengths
Lecture: 6th Intern. Workshop on Laser Beam and Optics
Characterization 18–20 June 2001
München

Steinert, J.; Glied, S.; Flemming, M.; Duparré, A.:
Instrument for light scatter measurements for 157 nm and 193 nm
Lecture: Topical Meeting and Tabletop Exhibit "Optical Interference Coatings" 15–20 July 2001
Banff/Kanada

Streppel, U.; Dannberg, P.; Wächter, C.; Bräuer, A.:
Realization of a vertical integration schema for polymer waveguides by a novel stacking technology
Lecture: Annual Meeting SPIE, August 2001 San Diego

Streppel, U.; Dannberg, P.; Wächter, C.; Bräuer, A.:
A novel fabrication technology for stacked polymer waveguide devices
Lecture: ECIO April 2001, Proceedings

Streppel, U.; Dannberg, P.; Wächter, C.; Bräuer, A.; Nicole, P.; Fröhlich, L.; Houbertz, R.; Popall, M.:
Multilayer optical fan-out device composed of stacked monomode waveguides
Lecture: Annual Meeting SPIE, August 2001 San Diego

Streppel, U.; Dannberg, P.; Wächter, C.; Bräuer, A.; Nicole, P.; Fröhlich, L.; Houbertz, R.; Popall, M.:
Development of a New Fabrication Method for Stacked Optical Waveguides Using Inorganic/Organic Copolymers
Lecture: First International IEEE Conference on Polymers and Adhesives in Microelectronics and Photonics, October 2001, Potsdam

Tikhonravov, A. V.; Trubetskov, M. K.; Duparré, A.; et al.:
Impact of systematic errors in spectral photometric data on the accuracy of determination of optical parameters of dielectric thin films
Lecture: Topical Meeting and Tabletop Exhibit "Optical Interference Coatings" 15–20 July 2001 Banff/Canada

Tikhonravov, A. V.; Trubetskov, M. K.; Duparré, A.; Tikhonravov, A. A.:
Influence of surface roughness on spectral properties of optical coatings
Lecture: Topical Meeting and Tabletop Exhibit "Optical Interference Coatings" 15–20 July 2001 Banff/Canada

Yulin, S.; Kuhlmann, T.; Feigl, T.; Kaiser, N.:
Damage Resistant and Low Stress EUV Multilayer Mirrors
Poster: SPIE's 26th Annual International Symposium on Microlithography, 25 February – 2 March 2001, Santa-Clara, USA

Zeitner, U.D.; Dannberg, P.:
Double-sided hybrid microoptical elements combining functions of multistage optical systems
Lecture: Annual Meeting SPIE, August 2001 San Diego

Zeitner, U.D.; Wyrowski, F.:
Design of hard-edged unstable laser resonators with userdefined mode shape
Lecture: Annual Meeting SPIE, August 2001 San Diego